

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 3 区分
 【発行日】平成 18 年 2 月 16 日 (2006.2.16)

【公開番号】特開 2004-276230 (P2004-276230A)
 【公開日】平成 16 年 10 月 7 日 (2004.10.7)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-039
 【出願番号】特願 2004-30069 (P2004-30069)
 【国際特許分類】

B 2 3 Q 11/10 (2006.01)

B 0 5 B 7/26 (2006.01)

F 1 6 N 7/34 (2006.01)

【F I】

B 2 3 Q 11/10 F

B 0 5 B 7/26

F 1 6 N 7/34

【手続補正書】
 【提出日】平成 17 年 12 月 26 日 (2005.12.26)
 【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

ガス供給源からのガスと液体の供給を受けてミストを生成し容器内に噴射する噴射器と、前記容器内の前記ミストを前記容器から導出する導管と、前記導管に連通するキャリアガス噴出口とを備えたミスト生成装置において、

前記ガス供給源から前記噴射器へガスを供給するガス供給路内に設置された第 1 の圧力制御手段と、

前記ガス供給源から前記キャリアガス噴出口へキャリアガスを供給するキャリアガス供給路内に設置され、二次側圧力を前記第 1 の圧力制御手段の二次側圧力を一定の比率で減圧した圧力に制御する第 2 の圧力制御手段とを備えたことを特徴とするミスト生成装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

ガス供給源からのガスと液体の供給を受けてミストを生成し容器内に噴射する噴射器と、前記容器内の前記ミストを前記容器から導出する導管と、前記導管に連通するキャリアガス噴出口とを備えたミスト生成装置において、

前記ガス供給源から前記噴射器へガスを供給するガス供給路内に設置された第 1 の圧力制御手段と、

前記ガス供給源から前記キャリアガス噴出口へキャリアガスを供給するキャリアガス供給路内に設置され、二次側圧力を前記第 1 の圧力制御手段の二次側圧力を一定の差圧で減圧した圧力に制御する第 2 の圧力制御手段とを備えたことを特徴とするミスト生成装置。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 9】

ガス供給源からのガスと液体の供給を受けてミストを生成し容器内に噴射する噴射器と、前記容器内の前記ミストを前記容器から導出する導管と、を備えたミスト生成装置において、

前記容器内の圧力を減圧する内圧減圧手段を有することを特徴とするミスト生成装置。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

上記目的を達成するため、本発明のミスト生成装置は、ガス供給源からのガスと液体の供給を受けてミストを生成し容器内に噴射する噴射器と、前記容器内の前記ミストを前記容器から導出する導管と、前記導管に連通するキャリアガス噴出口とを備えたミスト生成装置において、前記ガス供給源から前記噴射器へガスを供給するガス供給路内に設置された第1の圧力制御手段と、前記ガス供給源から前記キャリアガス噴出口へキャリアガスを供給するキャリアガス供給路内に設置され、二次側圧力を前記第1の圧力制御手段の二次側圧力を一定の比率で減圧した圧力に制御する第2の圧力制御手段とを備えたことを特徴とする。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

本発明の他のミスト生成装置は、ガス供給源からのガスと液体の供給を受けてミストを生成し容器内に噴射する噴射器と、前記容器内の前記ミストを前記容器から導出する導管と、前記導管に連通するキャリアガス噴出口とを備えたミスト生成装置において、前記ガス供給源から前記噴射器へガスを供給するガス供給路内に設置された第1の圧力制御手段と、前記ガス供給源から前記キャリアガス噴出口へキャリアガスを供給するキャリアガス供給路内に設置され、二次側圧力を前記第1の圧力制御手段の二次側圧力を一定の差圧で減圧した圧力に制御する第2の圧力制御手段とを備えたことを特徴とする。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0022】

本発明の更に他のミスト生成装置は、ガス供給源からのガスと液体の供給を受けてミストを生成し容器内に噴射する噴射器と、前記容器内の前記ミストを前記容器から導出する導管と、を備えたミスト生成装置において、前記容器内の圧力を減圧する内圧減圧手段を有することを特徴とする。